

**Renishaw, REVO®** 멀티 센서 시스템을 위한 새로운 비접촉식 비전 프로브 출시 발표

Renishaw가 3차원 측정기(CMM)에서 REVO 5축 측정 시스템과 함께 사용할 수 있는 새로운 비전 측정 프로브(RVP)를 출시한다고 발표했다. RVP는 시스템의 고속 접촉형 스캐닝 및 표면 처리 측정 기능인 기존 접촉식 트리거에 비접촉식 검사 기능을 더해 REVO의 멀티 센서 성능을 개선한다.

일부 분야에서는 전통적인 접촉형 프로빙 기술에 비해 비접촉식 검사가 확실히 우수한 것으로 확인되고 있다. 접촉형 측정에 적합하지 않은 0.5 mm 정도로 작은 크기의 수많은 구멍이 있는 얇은 판금 부품 또는 구성품을 RVP 시스템으로 완벽히 검사할 수 있다. RVP는 또한 REVO 헤드가 제공하는 5축 동작 및 무한 배치 기능을 활용하여 처리량과 CMM 성능을 대폭 개선한다.

RVP 시스템은 REVO에 사용할 수 있는 다른 모든 프로브 옵션과 함께 자동으로 상호 교환되는 폭넓은 모듈 및 하나의 프로브로 구성된다. 여러 센서에서 얻은 데이터는 공통 자료로 자동 참조된다. 이러한 유연성 덕분에 하나의 CMM 플랫폼에서 다양한 기능을 모두 검사할 수 있다.

각 모듈 내에 프로그래밍 방식 LED 조명이 부착되어 있어 RVP 사용 시 쉽게 부품을 찾을 수 있다. 또한 맞춤형 부품 고정물과 결합된 백라이트를 사용하여 배경 기능도 개선할 수 있다.

RVP 시스템은 REVO와 동일한 I++ DME 규격 인터페이스에 의해 관리되며 Renishaw의 MODUS™ 계측 소프트웨어에 의해 전체 사용자 기능이 제공된다. MODUS 비전 소프트웨어의 새로운 기능으로는 RVP 구성, 응용 분야별 옵션을 사용한 이미지 처리, 검토 및 향후 분석을 위한 자동 이미지 보관 등이 있다.

2015년 10월 5일부터 10일까지 이탈리아 밀라노에서 개최되는 EMO 2015에서, 방문객들은 Renishaw가 5번 홀 스탠드 D15에 전시하는 새로운 RVP 시스템을 만나볼 수 있다.

자세한 사항은 www.renishaw.co.kr/cmm를 참조하십시오.

끝